高活性材料の構造解析のための 雰囲気遮断システム

Air Protection System for Structural Analysis of High Active Materials

佐藤 高広, 森川 晃成, 鈴木 裕也, 岩堀 敏行 Takahiro Sato, Akinari Morikawa, Yuya Suzuki and Toshiyuki Iwahori

株式会社日立ハイテクノロジーズ

- 要旨 リチウムイオン電池電極材のような大気と反応し易い高 活性材料の構造解析を目的に、雰囲気遮断ホルダー、ロー ディングチャンバ装備のグローブボックス、集束イオン ビーム加工装置、電子顕微鏡から構成される雰囲気遮断 システムを開発し、充電済みリチウムイオン電池負極材 を用いてその有効性を検証した。その結果、前処理、加工、 観察・分析の全工程において、変質なく試料搬送が可能 であることを確認し、負極材中に存在する Li の分布を可 視化できた。
- キーワード:雰囲気遮断システム,集束イオンビーム加工装置, 電子顕微鏡,雰囲気遮断ホルダー,リチウムイオン 電池
- 1. はじめに

近年、環境・エネルギー問題への取り組みとして、蓄電池 材料などの研究開発が積極的に行われている。特に、リチウ ムイオン電池(Lithium ion battery: LIB) は、ノートパソコ ンや携帯電話などの民生機器の電源、自動車、鉄道車両など の産業機器の電源などに幅広く使われており、我々の日常生 活の中で必要不可欠な存在になっている¹⁾.一方で,より高 性能な LIB 開発のために、電子顕微鏡を用いて正極材や負 極材の充放電に伴う劣化構造の解析が行われている^{2.3)}.し かし、LIBは、活性の高いリチウムなどを含むため、極めて 変質し易い.そのため,通常の顕微鏡観察工程では,試料は 前処理や解析装置間搬送の際に大気に曝されるため、酸素や 水分などと反応し、構造変化する問題があった. これを回避 するために, 試料を大気曝露せずに透過電子顕微鏡 (Transmission electron microscope: TEM) や走査透過電子顕 微鏡 (Scanning transmission electron microscope: STEM) に 搬送可能なトランスファーチャンバや雰囲気遮断ホルダーが 開発されている^{4.5)}. これらの方法では, 薄膜やナノ粒子作

製用のチャンバー内から,試料を大気曝露することなく TEM/STEM 内へ導入できるため,as-grown 状態の構造を観 察することが可能である.しかし,一般的な LIB 構造解析 では,グローブボックス内部での電池解体,集束イオンビー ム (Focused ion beam: FIB)加工装置による薄膜試料作製, TEM/STEM による観察・分析の工程が必要である.全工程 において試料を大気曝露できないため,雰囲気遮断ホルダー だけでは LIB 構造解析は困難であった.そこで,LIB のよう な大気と反応し易い材料の構造解析を目的に,前処理装置や 解析装置間を雰囲気遮断して試料搬送できるシステムを開発 した.本稿では,本システムの概要と LIB 負極材を用いた 雰囲気遮断効果の検証結果について報告する.

2. 雰囲気遮断システムの概要

2.1 雰囲気遮断システムの構成

図1に雰囲気遮断システムの構成例を示す.本システムは、 雰囲気遮断ホルダー、ホルダ及び試料用ローディングチャン バを装備したグローブボックス、FIB-SEM、STEMから構 成されている.実験目的に合わせて、SEM、TEM、FIB装 置なども構成に追加することができる.

雰囲気遮断ホルダーは、試料の形状や解析目的に応じてバ ルク用と薄膜用の2種類開発した. 図2にバルク試料搭載 用雰囲気遮断ホルダーの外観写真を示す. 本ホルダーは、 キャップ及びホルダーから構成されている(図2(a)). 試料 は、試料搭載部に固定される. キャップ内部にOリングがあ り、キャップをホルダーに被せて雰囲気遮断する(図2(b)).







図2 バルク試料搭載用雰囲気遮断ホルダーの外観写真
 (a) 雰囲気遮断前,(b) 雰囲気遮断後

[〒] 312-0056 茨城県ひたちなか市石川町 11-1 TEL: 029-354-1970; FAX: 029-354-1971

キャップ内部は,真空または不活性ガス雰囲気で保持できる. 雰囲気遮断ホルダー内部を不活性ガスで保持し,FIB-SEM に搬送する.

図3に薄膜試料搭載用雰囲気遮断ホルダー先端部の模式 図を示す.本ホルダーは、FIB装置とTEM/STEMに共用可 能なサイドエントリー型試料ホルダーである.先端部の試料 搭載部には、薄膜試料用のサンプリキャリアが取付けられ、 摘出した試料を固定できる.先端部にはOリングが取付け られており(図3(a))、薄膜加工後の試料をシリンダ内部に 格納することで雰囲気遮断できる(図3(b)).シリンダ内部 を不活性ガスで保持し、試料をHD-2700STEM(図1(e))へ 搬送する.

ホルダー及び試料用ローディングチャンバを装備したグ ローブボックス(図1(a))では、窒素やアルゴンなど不活 性ガスを充満させ、その雰囲気中で試料の開封及び試料ホル ダーへの脱着作業を行う.本グローブボックスには、試料や 雰囲気遮断ホルダーを出し入れできるようローディングチャ ンバが装着されている.チャンバ内は、真空排気や不活性ガ ス充填することができる.あらかじめ、チャンバ内部を不活 性ガスで充満しておくことで、グローブボックス内部の不活 性ガス濃度を低下させずにホルダーや試料の出し入れができ る.

NB5000 FIB-SEM (図1(c)) は, 薄膜試料作製に用いら れる.本装置の試料交換室(バルク試料用及び薄膜試料用) では,不活性ガスパージを行うことができる.バルク試料用 の試料交換室で不活性ガスパージと真空引きを数回繰り返す ことで,より純度の高い不活性ガス雰囲気中でキャップを開 封することができる.また,本装置は,薄膜試料作製用にバ ルク試料から特定箇所を摘出可能なマイクロサンプリング[®] ユニットを備えている⁶.摘出した試料は,薄膜試料搭載用 雰囲気遮断ホルダー (図1(d))に固定する.薄膜試料用の 試料交換室で不活性ガスパージを行うことで,シリンダ内部 を不活性ガスで保持できる.

HD-2700 STEM (図1(e)) は、薄膜加工した試料の高分 解能 STEM 像観察及び分析に用いられる.本装置には、像 観察用の検出器として、二次電子 (Secondary electron: SE) 検出器、明視野 (Bright field: BF)-STEM 検出器、暗視野 (Annular dark field: ADF) -STEM 検出器が装備されている⁷⁾.



図3 薄膜試料搭載用雰囲気遮断ホルダー先端部の模式図 (a) 雰囲気遮断前,(b) 雰囲気遮断後

2.2 雰囲気遮断システムによる試料の前処理と搬送プロ セス

雰囲気遮断システムにより,試料開封から前処理,加工, 観察・分析までの全工程において,試料を全く大気曝露せず 搬送可能である^{8,9)}.そのプロセスを LIB 負極材試料の場合 を例にして説明する.

- (1) グローブボックス内部を不活性ガス濃度がほぼ100%に 近い状態で満たし,露点温度を -30℃ 以下に保持する.
- (2) グローブボックス内部で、密封された充電済みカーボン 負極材を開封する.なお、この条件は、LIBメーカーの 解体条件を再現している.
- (3) 試料をバルク試料搭載用雰囲気遮断ホルダーに固定し、 キャップ内部を不活性ガスで充満させる.
- (4) ホルダーは、不活性ガスで満たされたローディングチャンバを経て、グローブボックスから取り出される.
- (5) 試料を不活性ガスで保持したまま NB5000 に搬送する.
- (6) 試料交換室にホルダーを取付け、真空排気と不活性ガス パージを数回繰り返した後、キャップを外し、ホルダー を試料室内部に挿入する.
- (7) 薄膜試料作製には、FIB マイクロサンプリング[®]法を用いる. 40 kV-FIB を用いて薄膜加工後、FIB ダメージの除去に 5 kV-FIB を用いる.
- (8) 試料作製後, 試料交換室を不活性ガスでパージする.
- (9) 試料搭載部をシリンダ内部に格納し,不活性ガスで保持 したまま HD-2700 に搬送する.
- (10) HD-2700の試料交換室にホルダーを挿入し,真空排気後、シリンダ内部から試料搭載部を出し、試料室内部 へ挿入する.
- (11) SE/STEM 観察及び分析は、加速電圧 200 kV で行う. Liの組成分析は、電子線エネルギー損失分光法(Electron energy loss spectroscopy: EELS)を用いて実施する。特に、元素マッピング像を取得するために HD-2700 付属の EV3000 実時間元素分布像観察システム、スペクトルを取得するために Enfina100(GATAN 社)を用いる。EV3000 は、数十秒のスキャン時間での高速マッピングが可能であり、電子線照射によりダメージを受け易い試料でもマッピング像を取得できる。
 - リチウムイオン電池負極材による雰囲気遮断システム の有効性検証

3.1 表面・内部構造の保持

はじめに、グローブボックスと FIB-SEM 間の試料搬送に おける雰囲気遮断効果を検証した. 雰囲気遮断下で搬送した 試料と、大気曝露(約10分間)して搬送した試料の変質に よる表面形状の変化を比較した. 図4は、LIB 負極材表面の 走査イオン顕微鏡 (Scanning ion microscope: SIM) 像である. 雰囲気遮断した場合 (図4(a))、十数 μ m サイズのグラファ イトの形状や、その隙間が明瞭に観察された. 一方、大気曝 露(約10分間)した場合 (図4(b))、負極材の主構成材で あるグラファイトの輪郭は一部確認できるが,表面全体に凹 凸が発生し数 μm サイズの析出物 (例として○で囲んだ部分) も形成されている.これは,充電によって Li-rich になった 負極材が大気中の水分や酸素などと反応したためである.

次に, FIB-SEM と STEM 間の試料搬送における雰囲気遮 断効果を検証した. 雰囲気遮断下で搬送した薄膜試料の



図4 LIB 負極材表面の SIM 像 (a) 雰囲気遮断下,(b) 大気曝露(約10分間) 装置:NB5000 FIB-SEM,加速電圧:40 kV,観察倍率:2 k 倍



図5 LIB 負極材の BF-STEM 像 (a) 雰囲気遮断下,(b) 大気曝露(約10分間) 装置:HD-2700 STEM,加速電圧:200 kV,観察倍率:50 k 倍

STEM 像観察後,同一試料を外に取り出して大気曝露(約 10分間)し,再度 STEM 観察して内部構造の変化を比較した. 図5は,LIB 負極材薄膜試料の BF-STEM 観察結果である. 雰囲気遮断下では(図5(a)),グラファイトの層状構造や周 囲の微細構造が鮮明に観察されている.一方,大気曝露した 後の試料は(図5(b)),グラファイトやその周囲の構造が明 らかに変質している.

以上の結果,大気下で搬送した負極材は大気との接触により変質するが,雰囲気遮断ホルダーを使用することで,グロー ブボックスと FIB-SEM 間, FIB-SEM と STEM 間を試料変 質させず,本来の構造を保持したまま搬送可能であることが 示された.

3.2 組成, 化学結合状態の保持

LIB 負極材の変質(特に酸化)の有無を調べるため, EELS 分析を行った.はじめに,Liの分布を可視化するため に,元素マッピングを行った.図6は,雰囲気遮断下での LIB 負極材薄膜試料の STEM 観察及び EELS マッピング結 果である.図6(a)は BF-STEM 像,図6(b)は同視野の Li-K edge の EELS マッピング像である.マッピング像には, Liの分布が明瞭に観察されており,Liは均質に分布するの ではなく,部分的に偏在していることが分かる.STEM 像と 比較すると,Liは空隙部(矢印部1,2,3)やグラファイト 間(矢印4)などに分布していることが分かる.Liが検出さ れる領域は,負極材の電池特性に密接に影響する固体電解質



図 6 雰囲気遮断下での LIB 負極材の STEM 観察及び EELS 分析結果

 (a) BF-STEM 像, (b) Li-K edge EELS マッピング像 装置: HD-2700 STEM,加速電圧: 200 kV, 分析: EV3000 実時間元素分布像観察システム, 観察倍率: 80 k 倍



図7 雰囲気遮断下における LIB 負極材薄膜試料の SE 像 (a) 及び BF-STEM 像 (b) 装置: HD-2700 STEM, 加速電圧: 200 kV, 観察倍率: 100 k 倍

界面(Solid electrolyte interface: SEI)と考えられる¹⁰⁾.

次に、EELS スペクトルの形状から酸化の影響について調 べた.図7は、Liが検出された視野のLIB 負極材薄膜試料 の SE 像 (a) 及び BF-STEM 像 (b) である. 共に、 雰囲気 遮断下で観察した同一視野の像である. SE 像観察の結果, 空隙周囲のグラファイト表面に平坦な部分(領域1)と粒状 性のある部分(領域2)が存在していることが分かる.この 構造の違いは、透過像である BF-STEM 像には観察されてい ない. このように、SE 像観察は、Li が存在する領域の形態 判別に有効な手法であることが分かる.本実験では、まず、 各領域における EELS スペクトルを取得した. この時、標準 試料(酸化リチウム(Li₂O),フッ化リチウム(LiF))の EELS スペクトルも取得し、それらと比較した. 図8は、 LIB 負極材及び標準試料の EELS スペクトルである. 図8(a) は領域1とLi₂O,図8(b)は領域2とLiF(b)のEELSスペ クトルである. 領域1のスペクトルは、損失エネルギー約 58 eV に Li-K edge が観察された. このスペクトル形状は, Li₀Oと良く一致することが分かった.一方,領域2のスペ クトルには、損失エネルギー約 60 eV に Li-K edge が観察さ れ、これはLiFのスペクトル形状と一致することが分かった. すなわち、グラファイト表面の平坦部分にLi₂O、粒状性の



ある部分に LiF が存在していることが示された.極めて活性 な LiF が酸化されずに検出されたことから,雰囲気遮断シス テムを用いることで,試料本来の組成や化学結合状態を保持 したまま観察・分析が可能であることが確認できた.

4. おわりに

大気と反応し易い試料の構造解析を目的に, 雰囲気遮断シ ステムを開発し, LIB 充電済み負極材を用いて雰囲気遮断効 果の検証を行った. その結果, 雰囲気遮断ホルダーは, 負極 材の構造を保持したまま解析装置間を搬送することができ, 酸化の影響なく Li の分布を可視化することができた. 従来 法ではリチウムの分布を捉えることが困難であったが, 本シ ステムを用いることで, 大気と反応し易い負極材の前処理, 加工, 観察・分析に有効な手法であることが示された. 今後, 新素材やグリーン材料をはじめとする活性の高い材料への適 用が期待できる.

献

1) Tarascon, J.-M. and Armand, M.: Nature, 414, 359–367 (2001)

文

- Kikkawa, J., Akita, T., Tabuchi, M., Shikano, M., Tatsumi, K. and Kohyyama, M.: J. Appl. Phys., 103, 104911–104920 (2008)
- 3) 山田将之, 稲葉 章, 長山咲子, 松本和伸, 上田篤司, 小槻
 勉:第50回電池討論会講演要旨集, 191 (2009)
- Koguchi, M., Kakibayashi, H. and Nakatani, R.: *Jpn. J. Appl. Phys.*, 32, 4814–4818 (1993)
- 5) 熊本明仁, 墙内千尋, 齋藤嘉夫:日本顕微鏡学会 第65回学 術講演会予稿集, 178 (2009)
- Ohnishi, T., Koike, H., Ishitani, T., Tomimatsu, S., Umemura, K. and Kamino, T.: Proc. 25th Int. Symp. for Testing and Failure Analysis., 449–501 (1999)
- 7) 稲田博実,田村圭司,鈴木裕也,今野 充,中村邦康:顕微 鏡,46,2,140-144,(2011)
- 8) 森川晃成,工藤美樹,佐藤高広,奥島浩久,黒田靖,東 淳 三,大西毅:日本顕微鏡学会第66回学術講演会予稿集, 171 (2010)
- Sato, T., Kudo, M., Okushima, H., Morikawa, A., Kuroda, Y., Onishi, T. and Agemura, T.: Proc. Microscopy & Microanalysis, 212–213 (2010)
- 10) Peled, E.: J. Electrochem. Soc., 126, 2047-2051 (1979)